

令和7年2月14日

九州大学マテリアル先端リサーチインフラ事業 利用者各位

九州大学マテリアル先端リサーチインフラ事業
業務主任者 村上 恭和

電子顕微鏡関連設備の利用枠（時間帯設定）および利用料金に関わる お知らせ

平素は、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM）九州大学ハブをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

掲題の件についてご案内と、お願いを申し上げます。

1. 利用枠（時間帯設定）の変更について

設備や実験内容の高度化に伴い、ARIMのほか、本センターで実施される多くの課題において、技術職員による実験サポートの機会が増しています。これに伴い、技術職員の超過勤務が常態化しており、令和7年4月1日から利用枠（時間帯設定）を次のように変更させて頂く事となりました。

現在	：第1枠：10:00-14:00	第2枠：14:30-18:30	1枠あたり4時間
R7.4以降	：第1枠：9:30-13:00	第2枠：13:30-17:00	1枠あたり3時間30分

開始・終了時刻や1枠あたりの長さの変更については、利用者様への影響という観点で検討・議論を重ねて参りました。同時に、第1枠に先立つ調整作業時間（30分～1時間）の確保や、労務管理目線での第2枠の終了時刻設定^{※1、※2}などを考慮し、上記「R7.4以降」の形態が適切との判断に至りました。何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

※1：終了時刻17:00の設定については、他機関の電顕センターの設定も考慮しました。

※2：終了時刻17:00の後、センター職員による片付けやデータ整理等が実施されます。

2. 利用料金について

昨今の電気代の高騰を利用料金に反映し、令和7年4月1日より別添の通りの利用料金に改訂させていただきます。（上記の通り1枠の長さは若干短くなりましたが、電気代を考慮・反映した結果、枠当たりの利用料金は現状と概ね同様な金額となっております。）利用者の皆様におかれましては、何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。

九州大学ARIM事業 利用料金・利用時間枠 令和7年4月1日改訂予定

第1枠 9:30~13:00 第2枠 10:00~17:00

装置名	地区	新料金 (税込)						現行料金 (税込)					
		課金 単位	機器利用料		技術補助料 ※本学職員による補助が必要な場 合は、支援の程度に (A,B2通り) 応じ、各機器利用料に加算		課金 単位	機器利用料		技術補助料 ※本学職員による補助が必要な場 合は、支援の程度に (A,B2通り) 応 じ、各機器利用料に加算			
			データ提供あり	データ提供なし	技術補助料A	技術補助料B		データ提供あり	データ提供なし	技術補助料A	技術補助料B		
超高压電子顕微鏡 JEM-1300NEF	伊都	枠 (3.5h)	17,000	21,000	本学の職員が操 作の補助及び操 作方法の指導を 行いながら、利 用者自身が操作 する場合 4,600円 9,100円 (※利用装置の 操作経験がある 方に限ります)	利用者の立会い と指示のもと、 本学の職員が操 作する場合 9,100円	枠 (4h)	17,000	21,000	本学の職員が操 作の補助及び操 作方法の指導を 行いながら、利 用者自身が操作 する場合 5,100円 (※利用装置の操 作経験がある方 に限ります)	利用者の立会い と指示のもと、本 学の職員が操作 する場合 11,000円		
新高分解能電子顕微鏡 JEM-ARM300F2	伊都	枠 (3.5h)	75,000	89,000			枠 (4h)	75,000	89,000				
広電圧超高感度原子分解能電子顕微鏡 JEM-ARM200CF	伊都	枠 (3.5h)	17,000	20,000			枠 (4h)	17,000	20,000				
収差補正走査/透過電子顕微鏡 JEM-ARM200F	伊都	枠 (3.5h)	16,000	19,000			枠 (4h)	16,000	19,000				
汎用電子顕微鏡 JEM-2100F	伊都	枠 (3.5h)	9,400	12,000			枠 (4h)	9,900	12,000				
ハイコントラスト補助電子顕微鏡 JEM-2100HCKM	伊都	枠 (3.5h)	6,800	8,100			枠 (4h)	6,700	7,900				
マイクロリーザー-高エネルギー-分解能元素分析装置 付き走査電子顕微鏡 TES+ULTRA55	伊都	枠 (3.5h)	8,600	11,000			枠 (4h)	8,400	9,900				
デュアルビームFIB Quanta 3D 200i	伊都	枠 (3.5h)	14,000	16,000			枠 (4h)	14,000	16,000				
直交型FIB-SEM MI4000L	伊都	枠 (3.5h)	18,000	21,000			枠 (4h)	20,000	24,000				
イオンビーム・電子ビーム複合型精密加工 分析装置 Helios 5 UX	伊都	枠 (3.5h)	26,000	33,000			枠 (4h)	27,000	33,000				
クロスセクションポリリッシャ	伊都	枠 (3.5h)	2,700	3,200			枠 (4h)	2,700	3,200				
グローブボックス	伊都	枠 (3.5h)	7,600	9,000			枠 (4h)	7,600	9,000				
収差補正高分解能電子顕微鏡 JEM-ARM200F	筑紫	枠 (3.5h)	18,000	21,000			枠 (4h)	18,000	21,000				
三次元透過電子顕微鏡 Titan	筑紫	枠 (3.5h)	32,000	37,000			枠 (4h)	31,000	37,000				
三次元走査電子顕微鏡 Scios	筑紫	枠 (3.5h)	20,000	23,000			枠 (4h)	20,000	23,000				
デュアルビーム微細加工電子顕微鏡 Versa3D	筑紫	枠 (3.5h)	19,000	22,000	枠 (4h)	19,000	22,000						
キセノンプラズマ集束イオンビーム加工・ 走査電子顕微鏡複合機 Helios	筑紫	枠 (3.5h)	71,000	87,000	枠 (4h)	71,000	87,000						
雰囲気遮断加熱・冷却試料ホルダー	筑紫	枠 (3.5h)	1,600	1,800	枠 (4h)	1,600	1,800						
PIPS II M-695	伊都	枠 (3.5h)	1,100	1,300			枠 (4h)	1,200	1,400				
Nano MILL Model 1040	伊都	枠 (3.5h)	1,100	1,300			枠 (4h)	1,200	1,400				
イオンライザー EM-09100IS	伊都	枠 (3.5h)	1,100	1,300			枠 (4h)	1,200	1,400				
イオンコーター JFC-1600	伊都	回	550	660			回	550	660				
カーボンコーター EC 32010CC	伊都	回	550	660			回	550	660				